

AWL 系列 晶圆检查系统

AWL 系列晶圆检查系统兼具稳定性和安全性，能够安全可靠地传送晶圆，适合于前道到后道工程的晶圆检查。拥有 AWL046、AWL068、AWL812 三种机型，可适用于 4-12 英寸晶圆检测，适应范围广、搭配灵活。可自由设置的检查模式，充分符合人机工程学设计，操作舒适、简便。



AWL812



AWL046



AWL068

AWL 技术规格

型号	AWL046	AWL068	AWL812
晶圆尺寸	100mm / 150mm	150mm / 200mm	200mm / 300mm
晶圆最小厚度	150um	150um / 180um	180um / 250um
晶舟类型	Open Cassette/Smif Pod		Open Cassette / FOUP、FOSB/Smif Pod
检查模式设置	全检 / 奇数检 / 偶数检 / 手动选择		
晶舟扫描（有 / 无 / 斜片）	●	●	●
晶舟内凸片侦测报警	≥ 4mm		≥ 5mm
晶圆预定位（平边、Notch）	●	●	●
朝向设置（平边、Notch）	非接触式定位平边、Notch，支持 0°、90°、180°、270°朝向设置		
检查功能	晶面宏检（旋转）、晶背宏检 1（外圈、旋转）、晶背宏检 2（中心）		
外观尺寸（W×D×H）	1450×700×1600mm	1550×700×1600mm	2400×1400×2450mm
电源需求	1P / 220V / 10A		1P / 220V / 16A
真空需求（负压 / 正压）	-70KPA ~ -80KPA / 0.5MPA		
适用显微镜	SOPTOP MX68R 金相显微镜		
光学系统	无限远色差校正光学系统，放大倍率 50X-1000X		
观察方式	明场、暗场、偏光、DIC		
目镜	高眼点大视野平场目镜 PL10X22mm，可带视度可调，可带测微尺		高眼点大视野平场目镜 PL10X25mm，可带视度可调，可带测微尺
观察头	铰链三目观察筒，5-35 度倾角可调，正像，瞳距调节范围：50-76mm，两档式分光比，双目：三目=100：0，0：100		铰链三目观察筒，0-35 度倾角可调，正像，瞳距调节范围：50-76mm，两档式分光比，双目：三目=100：0，0：100
物镜	长工作距明暗场半复消色差金相物镜（20X、50X、100X） 明暗场半复消金相物镜（5X、10X、20X、50X、100X）		
转换器	明暗场 6 孔电动转换器（带 DIC 插槽）		
机架	反射式机架，前置低手位粗微同轴调焦机构，粗调行程 35mm，微调精度 0.001mm，带有防止下滑的松紧调节装置和随机上限位装置，内置 100-240V 宽电压系统 明暗场反射照明器，带视场光阑，可变电动孔径光阑，带明暗场切换装置，带滤色片及偏光装置插槽，带 12V10W LED 灯箱		明暗场反射照明器，带视场光阑，可变电动孔径光阑，带明暗场切换装置，带滤色片插槽与偏光装置插槽，带 12V10W LED 光源控制部件
载物台	6 英寸机械移动平台，低手位 X、Y 方向同轴调节，晶圆承片台面 φ38mm，可 360°旋转，移动行程 243mm(X 方向)×170mm(Y 方向)，观察范围：170mmX170mm，带离合器手柄	8 英寸机械移动平台，低手位 X、Y 方向同轴调节，晶圆承片台面 φ60mm，可 360°旋转，移动行程 288mm (X 方向) ×210mm (Y 方向)，观察范围：210mm×210mm，带离合器手柄	12 英寸自动平台，X、Y、Z、φ 多方向调节，晶圆承片台面 φ70mm，可 360°旋转，移动行程 600mm(X 方向)×500mm(Y 方向)，观察范围：310mm×310mm，φ 方向可 ±5 度旋转，各轴运动速度可以高低速切换
其他	滤色片插板、起 / 检偏镜插板、DIC 组件、摄像接口、调整平台、830 万像素彩色相机、专业晶圆检查软件等		

